

発送番号: 260822 発送日: 平成16年 7月16日 <u>l</u> due date

拒絕理由通知書

Official Action

due date ⁹/14 (火)

特許出願の番号

特願2002-223093

起案日

平成16年 7月14日

特許庁審査官

石田 宏之

9258 3N00

特許出願人代理人

山本 秀策(外 2名) 様

適用条文

第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において 頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属 する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができた ものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができな い。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項1-7に対して

引用文献1符号27,33参照。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、 現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には 拒絶の理由が通知される。

引用文献等一覧

1.特開平11-59893号公報

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 B65D

DB名

・先行技術文献

BEST AVAILABLE COPY

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-059893

(43)Date of publication of application: 02.03.1999

(51)Int.CI.

B65G 49/06

B65D 85/00

B65D 85/48

(21)Application number: 09-215000

(71)Applicant: FUJITSU LTD

FUJITSU VLSI LTD

(22)Date of filing:

08.08.1997

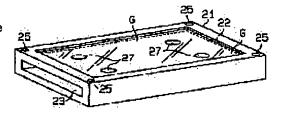
(72)Inventor: KISHI AKIHIRO

(54) HOLDER, CONVEYER AND DELIVERY STAGE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a holder whereby a thin plate-shaped conveyed object of large area is prevented from being damaged, the conveyed object can be easily conveyed.

SOLUTION: In a base board holder 21, a receiving part 22, which receives a glass base board G as a thin plate-shaped conveyed object, is hollowly provided. The receiving part 22 is formed in a manner wherein an upper surface of the received glass base board G is lower than an upper surface of the base board holder 21. The glass base board G, in a condition received to the receiving part 22 of the base board holder 21, is conveyed. Accordingly, the glass base board G is conveyed without deflection by the base board holder 21.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-59893

(43)公開日 平成11年(1999)3月2日

(51) Int.Cl. ⁶		AM DISTIFU						
(31)1111401.		識別記号	FΙ					
B65G	49/06 85/00 85/48		B65G 49/06		Z			
B65D 8			B65D 8	5/00		F		
8			8	5/48				
			審査請求	未請求	請求項の数7	OL	(全 8 頁)	
(21)出願番号		特願平9-215000	(71) 出願人	000005223 富士通株式会社				
(22)出顧日		平成9年(1997)8月8日		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番				
			(71)出願人	(71)出願人 000237617 富士通ヴィエルエスアイ株式会社 愛知県春日井市高蔵寺町2丁目1844番2				
			(72)発明者	岸 昭洋 愛知県春日井市高巌寺町二丁目1844番2 富士通ヴィエルエスアイ株式会社内				
			(74)代理人	弁理士	恩田 博宜			

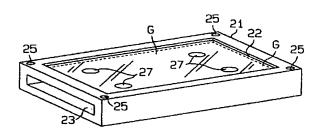
(54)【発明の名称】 ホルダ、搬送装置、及び、受け渡しステージ

(57)【要約】

【課題】面積の大きな薄板状の被搬送物の破損を防ぎ容易に搬送することのできるホルダを提供すること。

【解決手段】基板ホルダ21には、薄板状の被搬送物としてのガラス基板Gを収容する収容部22が凹設されている。収容部22は、収容されたガラス基板Gの上面が基板ホルダ21の上面21aよりも低くなるように形成されている。そして、ガラス基板Gは、基板ホルダ21の収容部22に収容された状態で搬送される。従って、ガラス基板Gは、基板ホルダ21によって撓まずに搬送される。

一実施形態の基板木ルダの斜視図



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 薄板状の被搬送物を搬送装置にて搬送す るために用いられるホルダであって、

上方に開口し、前記被搬送物を収容する収容部と、

前記搬送装置のアームが側方から挿入される挿入孔とを 備えたホルダ。

【請求項2】 請求項1に記載のホルダにおいて、 ホルダの上面と下面のうちの何れか一方には突起を形成 し、他方には前記突起が挿入される凹部を形成したホル ダ。

【請求項3】 請求項1又は2に記載のホルダにおい て、

前記搬送装置に備えられ、ホルダを持ち上げるためのア ームの上面と、前記アームが挿入される挿入孔の天井面 のうちの何れか一方にはアライメントピンを形成し、他* 方には前記アライメントピンが挿入されてアームに対す る位置を補正するためのアライメント穴を形成したホル

【請求項4】 請求項1乃至3のうちの何れか1項に記 載のホルダにおいて、

前記収容部内を垂直方向に貫通して形成され、ステージ に立設されたロッドが前記ステージに載置する際に挿通 される挿通孔を形成したホルダ。

【請求項5】 請求項4に記載のホルダにおいて、

前記挿入孔の底面には前記挿通孔を塞ぐための蓋を備 え、該蓋は前記ステージに設けられたロッドにより自動 的に開閉操作されるようにしたホルダ。

【請求項6】 請求項1乃至5のうちの何れか1項に記 載のホルダを搬送する搬送装置。

【請求項7】 請求項4又は5に記載のホルダが載置さ れる受け渡しステージであって、

前記ホルダが載置される台部と、

前記台部に立設され、前記ホルダを載置する際に該ホル ダに形成された挿通孔に挿通され、前記ホルダの収容部 に収容された被搬送物を所定位置に保持するロッドとを 備えた受け渡しステージ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はガラス基板等の薄板 び、搬送装置に関するものである。

【0002】近年、液晶表示装置(LCD)等のフラッ ト・パネル・ディスプレイ(FPD:flat panel displ ay)では、表示範囲の拡大が図られており、それに伴っ てパネルに用いられるガラス等の基板の面積が大きくな ってきている。そして、面積の大きなガラス基板は破損 しやすいことから、その破損を防いで搬送することが要 求されている。

[0003]

視図である。カセット71には、表示装置に用いられる ガラス基板Gが複数納められている。搬送ロボット72 は、支持台73上に第1アーム74及び第2アーム75 を備える。第1アーム74は、支持台73上に水平面内 を回動可能に設けられると共にその回動軸に沿って上下 動可能に設けられている。第2アーム75は、第1アー ム74に沿って水平方向に往復動可能に支持されてい

【0004】また、基板搬送装置は、搬送ロボット72 を駆動制御する制御部(図示略)を備えている。制御部 は、第1アーム74及び第2アーム75を駆動制御して ガラス基板を搬送する。即ち、制御部は、第2アーム7 5を搬送しようとするガラス基板Gと下段のガラス基板 Gとの間に挿入させ、ガラス基板Gを持ち上げてカセッ ト71から引き抜き、図示しない処理装置等へ搬送す

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、表示範囲の 拡大などによってガラス基板Gの面積が大きくなると、 20 ガラス基板Gのたわみが大きくなり、カセット71に納 められた上下のガラス基板Gの間隔が狭くなる。する と、図12(a)に示すように、搬送ロボット72が第 2アーム75を挿入する際に、第2アーム75がガラス 基板Gと接触してガラス基板Gの表面を傷つけてしまう おそれがある。第2アーム75の幅を狭くするとガラス 基板Gの間に第2アーム75を挿入することが可能とな るが、安定してガラス基板Gを搬送できなくなると共 に、持ち上げるときにガラス基板Gが撓むため、図12 (b) に示すように、搬送しようとするガラス基板Gが 上段の基板と接触してしまうため、やはりガラス基板G の表面を傷つけてしまうおそれがあった。

【0006】また、搬送ロボットには、アーム上のガラ ス基板を両側から挟み込んで搬送するものがある。しか しながら、ガラス基板を挟み込む方法では、ガラス基板 に挟む圧力が加わり、その圧力によって薄いガラス基板 に欠け等が発生する場合があった。

【0007】本発明は上記問題点を解決するためになさ れたものであって、その目的は面積の大きな薄板状の被 搬送物の破損を防ぎ容易に搬送することのできるホル 状の被搬送物を収容して搬送するホルダ、ステージ、及 40 ダ、搬送装置、及び、受け渡しステージを提供すること にある。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、請求項1に記載の発明は、薄板状の被搬送物を搬送 装置にて搬送するために用いられるホルダであって、上 方に開口し、前記被搬送物を収容する収容部と、前記搬 送装置のアームが側方から挿入される挿入孔とを備え tc.

【0009】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載 【従来の技術】図11は、従来の基板搬送装置の概略斜 50 のホルダにおいて、上面と下面のうちの何れか―方には

突起を形成し、他方には前記突起が挿入される凹部を形成した。

【0010】請求項3に記載の発明は、請求項1又は2に記載のホルダにおいて、前記搬送装置に備えられ、ホルダを持ち上げるためのアームの上面と、前記アームが挿入される挿入孔の天井面のうちの何れか一方にはアライメントピンを形成し、他方には前記アライメントピンが挿入されてアームに対する位置を補正するためのアライメント穴を形成した。

【0011】請求項4に記載の発明は、請求項1乃至3のうちの何れか1項に記載のホルダにおいて、前記収容部内を垂直方向に貫通して形成され、ステージに立設されたロッドが前記ステージに載置する際に挿通される挿通孔を形成した。

【0012】請求項5に記載の発明は、請求項4に記載のホルダにおいて、前記挿入孔の底面には前記挿通孔を塞ぐための蓋を備え、該蓋は前記ステージに設けられたロッドにより自動的に開閉操作されるようにした。

【0013】請求項6に記載の発明は、請求項1乃至5のうちの何れか1項に記載のホルダを搬送する。請求項207に記載の発明は、請求項4又は5に記載のホルダが載置される受け渡しステージであって、前記ホルダが載置される台部と、前記台部に立設され、前記ホルダを載置する際に該ホルダに形成された挿通孔に挿通され、前記ホルダの収容部に収容された被搬送物を所定位置に保持するロッドとを備えた。

【0014】(作用)従って、請求項1に記載の発明によれば、薄板状の被搬送物はホルダに形成された収容部に収容される。そのホルダは、挿入孔に挿入される搬送装置のアームによって搬送される。そのため、被搬送物 30は撓まずに安定して搬送される。

【0015】請求項2に記載の発明によれば、ホルダの上面と下面のうちの何れか一方には突起が形成され、他方には突起が挿入される凹部が形成される。そのため、ホルダを積み重ねた場合に、突起が凹部に挿入されて位置決めされる。

【0016】請求項3に記載の発明によれば、搬送装置に備えられ、ホルダを持ち上げるためのアームの上面と、アームが挿入される挿入孔の天井面のうちの何れか一方にはアライメントピンが形成され、他方にはアライメントピンが挿入されるアライメント穴が形成される。そのため、アームにてホルダを持ち上げる時にアームに対する位置が補正されるので、アームの位置合わせを精度よく行う必要が無く、その分搬送時間が短くなる。

【0017】請求項4に記載の発明によれば、ホルダには、収容部内を垂直方向に貫通して挿通孔が形成される。そして、ステージに立設されたロッドがステージにホルダが載置する際にロッドが挿通孔に挿通され、収容部に収容された被搬送物が取り出されてロッド先端に保持される。

【0018】請求項5に記載の発明によれば、挿入孔の底面には挿通孔を塞ぐための蓋を備え、該蓋はステージに設けられたロッドにより自動的に開閉操作される。そのため、被搬送物を収容したホルダが積み重ねられたとき、蓋によって挿通孔から塵等の進入が防止され、被搬送物の表面に塵等が付着しない。

【0019】請求項6に記載の発明によれば、請求項1 乃至5のうちの何れか1項に記載のホルダが搬送装置に よって安定して搬送される。請求項7に記載の発明によ れば、請求項4又は5に記載のホルダが載置される受け 渡しステージには、ホルダが載置される台部と、台部に 立設され、ホルダを載置する際に該ホルダに形成された 挿通孔に挿通され、ホルダの収容部に収容された被搬送 物を所定位置に保持するロッドとが備えられる。ロッド によってホルダに収容された被搬送物が所定高さに保持 される。

[0020]

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体化した一実施の形態を図1~図6に従って説明する。図6は、基板搬送装置の構成を示す斜視図である。基板搬送装置11は、制御部12及び搬送ロボット13を備える。搬送ロボット13は、支持台14上に第1アーム15及び第2アーム16を備える。第1アーム15は、支持台14上に水平面内を回動可能に設けられると共にその回動軸に沿って上下動可能に設けられている。第2アーム16は平面矩形状に形成され、第1アーム15に沿って往復動可能に支持されている。また、第2アーム16上面には、アライメントピン17が形成されている。本実施形態では、円錐形凸状のアライメントピン17が、矩形頂点位置に4個突設されている。

【0021】制御部12は、基板ホルダ21を搬送するための制御プログラムが予め記憶されている。制御部12は、制御プログラムに基づいて搬送ロボット13を駆動制御し、基板ホルダ21を搬送する。

【0022】次に、基板ホルダ21について詳述する。 図1は基板ホルダ21の概略斜視図、図2は基板ホルダ 21の概略正面断面図、図3は基板ホルダ21の側断面 図である。

【0023】基板ホルダ21には、薄板状の被搬送物としてのガラス基板Gを収容する収容部22が凹設されている。収容部22は、収容されたガラス基板Gの上面が基板ホルダ21の上面21aよりも低くなるように形成されている。即ち、ガラス基板Gは、基板ホルダ21の収容部22に収容された状態で搬送される。従って、ガラス基板Gは、基板ホルダ21によって撓まずに搬送される。また、ガラス基板Gは搬送時に挟まれたりしないため、圧力等の影響を受けない。そのため、ガラス基板Gが搬送中に欠けるおそれがない。

【0024】基板ホルダ21には、挿入孔23が形成さ 50 れている。挿入孔23は、基板ホルダ21を貫通してい

る。また、挿入孔23は、開口が矩形状に形成されてお り、上記第2アーム16が挿入可能な大きさに形成され ている。基板ホルダ21は、挿入孔23に挿入された第 2アーム16により持ち上げられ、搬送される。

【0025】図3 (a) に示すように、挿入孔23の天 井面23aには、アライメント穴24が形成されてい る。アライメント穴24は、位置、形状、及び個数が第 2アーム16上面に形成されたアライメントピン17の 位置、形状、及び個数に対応している。即ち、アライメ ント穴24は、矩形頂点位置に円錐形凹状に4個形成さ れている。従って、図3(b)に示すように、第2アー ム16が基板ホルダ21を持ち上げる際に、アライメン トピン17がアライメント穴24に挿入され、第2アー ム16に対する基板ホルダ21の位置が常に一定とな る。即ち、第2アーム16は、位置合わせを正確にしな くても常に同じ状態で基板ホルダ21を持ち上げること ができる。

【0026】基板ホルダ21を安定して搬送するために は、基板ホルダ21に対して第2アーム16を精度よく 位置合わせする必要がある。そして、第2アーム16の 20 位置合わせに要する時間は、精度よく行おうとするほど 長くなる傾向にある。しかしながら、本実施形態では、 アライメントピン17及びアライメント穴24によって 第2アーム16の位置合わせを正確に行わなくても、基 板ホルダ21を持ち上げるだけで第2アーム16に対す る基板ホルダ21の位置を常に一定にすることができ る。そのため、第2アーム16は性格に位置合わせする 必要がないので、その分基板ホルダ21を持ち上げるま での時間が短くなり、搬送時間を短縮する、即ち高速に 且つ安定して基板ホルダ21を搬送することができる。 【0027】また、第2アーム16が水平動、回動駆動 されるときに、その第2アーム16に対する基板ホルダ 21の水平方向の移動が規制される。即ち、第2アーム 16に対する基板ホルダ21の位置がずれない。そのた め、第2アーム16を高速で駆動させることが可能とな り、その分搬送時間を短縮する、即ち高速且つ安定して 基板ホルダ21を搬送することができる。

【0028】また、基板ホルダ21の上面21aには、 所定位置に複数の凹部25が形成され、下面21bには 所定位置に複数の突起26が形成されている。凹部25 は円錐状に凹設され、突起26は円錐状に突設されてい る。また、凹部25及び突起26は、形成された位置及 び個数が対応している。更に、凹部25及び突起26 は、その形状が対応している。

【0029】即ち、図2に示すように、複数の基板ホル ダ21を積み重ねた場合、上段の基板ホルダ21下面2 1 b に形成された突起26が下段の基板ホルダ21上面 21aに形成された凹部25に挿入される。 これによ り、下段の基板ホルダ21に対して上段の基板ホルダ2

た、積み重ねられた基板ホルダ21は、凹部25及び突 起26が係合することにより、左右方向に力が加わって もずれることはない。

【0030】図6に示すように、基板ホルダ21は、搬 送装置11によって受け渡しステージ31に搬送され る。受け渡しステージ31は、基板ホルダ21に収容さ れて搬送されたガラス基板Gを、処理装置側の搬送装置 (いずれも図示略)に受け渡すために設けられている。 【0031】受け渡しステージ31は、台部32及びそ の台部32に立設されたロッド33により構成されてい る。本実施形態では台部32には4本のロッド33が立 設されている。各ロッド33は同じ長さの円柱よりな り、各上端が半球状に形成されている。

【0032】また、基板ホルダ21には、各ロッド33 に対応する位置に上下に貫通してロッド33が挿通可能 なする挿通孔27が形成されている。制御部12は、搬 送口ボット13を駆動制御して挿通孔27にロッド33 を挿入して基板ホルダ21を台部32上に載置する。す ると、基板ホルダ21に収容され搬送されたガラス基板 Gは、ロッド33により基板ホルダ21から取り出され て所定高さに保持され、台部32上には空の基板ホルダ 21が積み重ねられる。ロッド33に保持されたガラス 基板Gは、処理装置側の搬送装置に設けられたアーム4 1により持ち上げられ、処理装置内に搬送される。

【0033】一方、処理装置にて処理されたガラス基板 Gは、搬送装置のアーム41によってロッド33上に載 置される。制御部12は、搬送ロボット13を駆動制御 し、空の基板ホルダ21を持ち上げる。すると、ガラス 基板Gは、持ち上げられた基板ホルダ21の収容部22 に収容され、搬送される。

【0034】とのようにして、基板ホルダ21により搬 送されたガラス基板Gは、受け渡しステージ31に基板 ホルダ21を載置するだけでその基板ホルダ21から取 り出され、処理装置内に搬送される。また、基板ホルダ 21からロッド33によって取り出されたガラス基板G は、一定の位置に保持されるため、処理装置側の搬送装 置は、常に同じ位置にてガラス基板Gの受け渡しを行う ことができる。

【0035】また、図4、5に示すように、基板ホルダ 21には、挿入孔23の底面23bに蓋28が回動可能 に設けられている。 蓋28は、ガラス基板Gを収容した 基板ホルダ21を積み重ねた時に、挿通孔27を塞ぐた めに設けられている。即ち、図4に示すように、基板ホ ルダ21を積み重ねた場合、一点鎖線で示す下段の基板 ホルダ21に収容されたガラス基板Gの上面は、積み重 ねられた上段の基板ホルダ21により覆われる。そし て、上段の基板ホルダ21に形成された挿通孔27は、 挿入孔23の底面に設けられた蓋28によって塞がれる ため、収容部22が閉塞され、下段のガラス基板Gの上 1が所定位置に位置決めされながら積み重ねられる。ま 50 面に塵が付着するのが防止される。また、蓋28は、基

(5)

板ホルダ21を図6に示す受け渡しステージ31に載置 するときに、ロッド33によって押されて自動的に開 き、ステージ31から基板ホルダ21を搬送すると自重 によって自動的に閉じる。そのため、蓋28を開閉する ための操作を必要としない。

【0036】以上記述したように、本実施の形態によれ ば、以下の効果を奏する。

○基板ホルダ2 1 には、薄板状の被搬送物としてのガラ ス基板Gを収容する収容部22が凹設されている。収容 部22は、収容されたガラス基板Gの上面が基板ホルダ 10 21の上面21aよりも低くなるように形成されてい る。即ち、ガラス基板Gは、基板ホルダ21の収容部2 2に収容された状態で搬送される。従って、ガラス基板 Gは、基板ホルダ21によって撓まずに搬送される。ま た、ガラス基板Gは搬送時に挟まれたりしないため、圧 力等の影響を受けない。そのため、ガラス基板Gが搬送 中に欠けるおそれがない。

【0037】○挿入孔23の天井面23aには、アライ メント穴24が形成されている。アライメント穴24 は、位置、形状、及び個数が第2アーム16上面に形成 20 されたアライメントピン17の位置、形状、及び個数に 対応している。即ち、アライメント穴24は、矩形頂点 位置に円錐形凹状に4個形成されている。第2アーム1 6が基板ホルダ21を持ち上げる際に、アライメントピ ン17がアライメント穴24に挿入され、第2アーム1 6に対する基板ホルダ21の位置が常に一定となり、位 置合わせを正確にしなくても常に同じ状態で基板ホルダ 21を持ち上げることができるので、 高速且つ安定して 基板ホルダ21を搬送することができる。

【0038】〇基板ホルダ21の上面21aには、所定 30 位置に複数の凹部25が形成され、下面21bには所定 位置に複数の突起26が形成されている。凹部25は円 錐状に凹設され、突起26は円錐状に突設されている。 従って、積み重ねられた基板ホルダ21は、凹部25及 び突起26が係合することにより、左右方向に力が加わ ってもずれることはない。

【0039】○基板ホルダ21には、挿入孔23の底面 23 b に蓋28 が回動可能に設けられている。蓋28 は、ガラス基板Gを収容した基板ホルダ21を積み重ね た時に、挿通孔27を塞ぐために設けられている。即 ち、基板ホルダ21を積み重ねた場合、一点鎖線で示す 下段の基板ホルダ21に収容されたガラス基板Gの上面 は、積み重ねられた上段の基板ホルダ21により覆われ る。そして、上段の基板ホルダ21に形成された挿通孔 27は、挿入孔23の底面に設けられた蓋28によって 塞がれるため、収容部22が閉塞され、下段のガラス基 板Gの上面に塵が付着するのが防止される。

【0040】○蓋28は、基板ホルダ21を受け渡しス テージ31に載置するときに、ロッド33によって押さ

搬送すると自重によって自動的に閉じる。そのため、蓋 28を開閉するための操作を必要としない。

【0041】尚、本発明は前記実施の形態の他、以下の 態様で実施してもよい。上記実施形態では、受け渡しス テージ31に立設したロッド33によって基板ホルダ2 1に収容されたガラス基板Gを取り出すようにしたが、 その他の構成によって基板ホルダ21からガラス基板G を取り出すようにしてもよい。例えば、図7,図8に示 すように、基板ホルダ21に、ガラス基板Gを吊り下げ るためのし字状の吊り下げ部材51を挿入する挿入部5 2を設ける。この構成よれば、吊り下げ部材51により 吊り下げられたガラス基板Gが撓むものの、ロッド33 を挿入する挿通孔27を設ける必要がないので、蓋28 も必要がなく、基板ホルダ21を積み重ねた時に容易に 収容部22を閉塞してガラス基板Gの上面を覆い、塵等 の付着を防止する事ができる。

【0042】また、図9、図10に示すように、ガラス 基板Gの下方に基板ホルダ21の一側面から図6に示す アーム41を挿入する凹部55を形成する。との構成に よれば、収容部22を閉塞することができなくなるもの の、ガラス基板Gを容易に基板ホルダ21から取り出す ととができる。

【0043】上記実施形態ではアライメントピン17を 円錐形凸状に、アライメント穴24を円錐形凹状に形成 したが、ピン17及び穴24の形状が対応しているのな らばどの様な形状でも良く、例えば角錐凸状と角錐凹 状、半球凸状と半球凹状等の任意の形状に形成してもよ

【0044】上記実施形態では、凹部25及び突起26 をそれぞれ円錐状に形成したが、凹部25及び突起26 の形状が対応しているのならばどの様な形状でも良く、 例えば角錐凸状と角錐凹状、半球凸状と半球凹状等の任 意の形状に形成してもよい。

【0045】上記実施形態では、非搬送基板として矩形 状のガラス基板Gを搬送する基板ホルダ21に具体化し たが、ガラス以外の材質よりなる基板、矩形以外の形状 の基板を搬送する基板ホルダに具体化して実施してもよ いり

【0046】上記実施形態では、凹部25を基板ホルダ 40 21の上面21aに、突起26を下面21bに形成した が、凹部25を下面21bに、突起26を上面21aに 形成して実施してもよい。また、上記実施形態では、第 2アーム16の上面にアライメントピン17を、基板ホ ルダ21の挿入孔23の天井面23aにアライメント穴 24を形成したが、アライメントピン17を天井面23 aに、アライメント穴24を第2アーム16上面に形成 して実施してもよい。

[0047]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、 れて自動的に開き、ステージ31から基板ホルダ21を 50 面積の大きな薄板状の被搬送物の破損を防ぎ容易に搬送 9

することが可能なホルダ、搬送装置、及び、受け渡しス テージを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 一実施形態の基板ホルダの斜視図。
- 【図2】 積み重ねた基板ホルダの正面断面図。
- 【図3】 (a)(b)は基板ホルダとアームの関係を示す側断面図。
- 【図4】 ステージと基板ホルダの動作の関係を示す一部断面図。
- 【図5】 基板ホルダのふたを示す一部平面図。
- 【図6】 基板搬送装置の構成を示す斜視図。
- 【図7】 別の基板ホルダの平面図。
- 【図8】 B-B線断面図。

*【図9】 別の基板ホルダの平面図。

【図10】 C-C線断面図。

【図11】 従来の基板搬送装置の斜視図。

【図12】 (a) (b) は、従来の搬送状態を示す説明図。

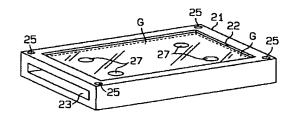
10

【符号の説明】

- 11 搬送装置
- 16 第2アーム
- 21 基板ホルダ
- 10 22 収容部
 - 23 挿入孔
 - G 被搬送物としてのガラス基板

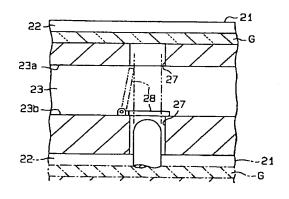
【図1】

一実施形態の基板ホルダの斜視図



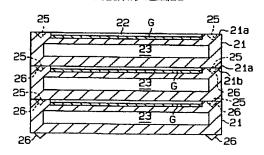
【図4】

ステージと基板ホルダの動作の関係を示す一部所面図



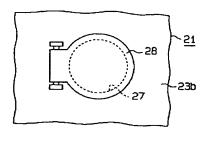
[図2]

積み重ねた基板木ルダの正面断面図



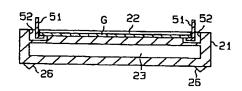
【図5】

基板木ルダのふたを示す一部平面図



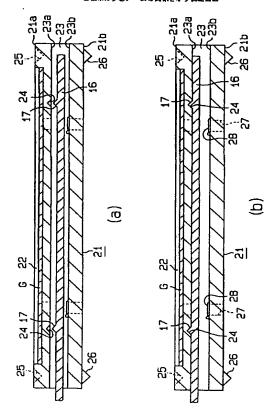
[図8]

B-B暴馬面図



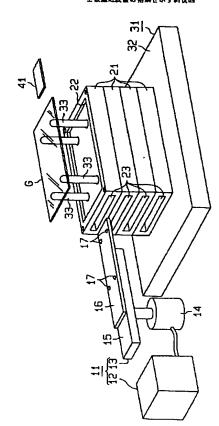
【図3】

基板ホルダとアームの関係を示す側断面図



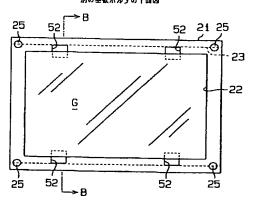
【図6】

基板鑑送装置の構成を示す斜模図



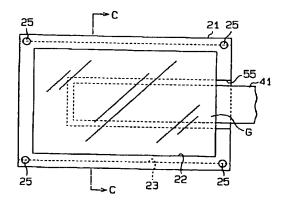
[図7]

別の基板木ルダの平面図



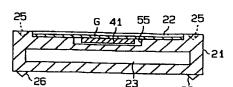
【図9】

別の基板ホルダの平面図



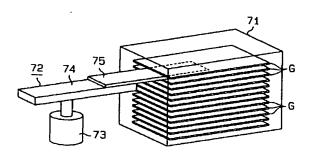
【図10】

C-C製版面図



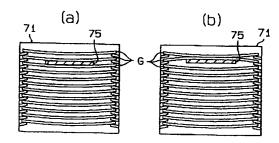
【図11】

従来の基板搬送装置の斜視図



【図12】

後来の撤送状態を示す説明図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY